

入門機器分析【8】

蛍光X線分析

【日時】 2018/9/20 (木) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部第2講義室 (西講義棟2階)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社島津製作所

13:00-15:00 蛍光X線分析の基礎

蛍光X線分析の原理、装置、定性分析、定量分析（検量線法、FP法）、分析結果の評価方法、試料前処理について説明します。

15:10-16:00 アプリケーションの紹介-薄膜・異物解析・微量分析-

蛍光X線分析は固体・粉末・液体・薄膜など、様々な形態の試料が分析可能です。ここでは蛍光X線分析の測定応用例について解説します。

16:00-17:00 EDXのFAQ

エネルギー分散型蛍光X線分析装置を使用する上で、よくある質問とその回答についてわかりやすく解説します。

機器分析は、研究開発に必要不可欠な手段であり、その手段は多岐に渡ります。今年度のセミナーは比較的ポピュラーな機器分析に関して初心者にもわかりやすく解説していきます。今回は、蛍光X線分析に関して知識が得られる内容です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 Tel.092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp